Si 製高集積熱電発電モジュールの最適設計: Si ナノワイヤの熱伝導率が発電性能に与える影響

Optimum Design of Si-based Integrated Thermoelectric Generator Module: Impact of Thermal Conductivity of Si-nanowires on the Module Performance 早大理工¹、静岡大学²、産総研³、⁰安部 克基¹、織田 海斗¹、富田 基裕¹ 猪川 洋²、池田 浩也²、松川 貴³、松木 武雄^{1,3}、渡邊 孝信¹ Waseda Univ.¹, Shizuoka Univ.², AIST³, ⁰K.Abe¹, K.Oda¹, M.Tomita¹, H.Inokawa², H.Ikeda²,

T.Matsukawa³, T.Matsuki^{1,3} and T.Watanabe¹

E-mail: katsube.aki@akane.waseda.jp

【はじめに】IoT 時代の新たな電源技術として、 熱電発電をはじめとするエナジー・ハーベステ イングに期待が寄せられている。近年、ナノサ イズの Si が優れた熱電変換能力を示すことが 明らかにされている[1]。我々の研究グループ は、Si ナノワイヤ(Si-NW)を用いた熱電発電デ バイスの構造を考案し[2]、微細化によって発 電性能が向上することを実証してきた[3]。 我々が提案する熱電発電デバイスを IoT デバイ スなどに適用するには、このデバイスの高密度 集積化が必要である。これまで、集積化モジュ -ルの発電性能を最大にする構造とサイズを 詳細に明らかにするため、有限要素法(FEM)を 用いたデバイス設計に取り組んできた[3,4]。 Si-NW 長さについてはサブ μm に最適値がある とを報告したが[3]、Si-NWの太さおよび熱伝 導率が発電力に与える影響ついてはまだ検討 していなかった。Si-NW を細くすると熱伝導率 が下がるが、熱伝導率は Si-NW 表面形状にも依 存するという報告もある[5]。 今回、発電性能を 最大化するSi-NWの最適な高さおよび長さに対 する影響を解析した結果を報告する。

【計算方法】FEM計算で使用したモデルをFig.1 に示す。n型Si-NWのみを用いる、いわゆるユ ニレグ型熱電発電素子が二つ含まれており、各 素子の高温側同士が隣り合わせになるように 配置されている。二つの素子は、第一 A1 配線 層(1st Al wiring layer)を通じて電気的に接続 されている。第一 A1 配線層と SiO2 を挟んで電 気的に絶縁された第二 Al 配線層(Heat source) のコンタクト部分(Al heat guide layer)を通 じて第一 A1 配線層に熱流のみが優先的に導か れる。NW の長さを 250nm~1000nm、厚さを 50nm ~230nm の範囲で変化させ、単位面積当たりの 発電量を比較した。Si-NW 両端の Si パッドの幅 ならびに A1 配線の幅は 1200nm、Si パッドと A1 配線をつなぐ A1 コンタクトの幅は 600nm に固 定した。デバイス上面は温度 298.15K の高温熱 源に、底面は293.15Kの低温熱源に接している。 SOI 層の NW 以外の部分、SiO2、A1 の熱伝導率は 131W/m·K、1.4 W/m·K、238 W/m·K に設定した。 バルクの Si の熱伝導率は、131W/m·K である。 Si-NW の熱伝導率はサイズに大きく依存し、数 10 ナノメートルまで細かくなるとバルクの 1/10~1/100 まで低下することが知られている [6]。本研究では、これまでの我々の試作デバイ スを用いた評価結果とさらなる評価結果を参 考に[7]、Si-NW の熱伝導率を 1.4 W/m·K と 16.5 W/m·K に設定し、発電性能を比較した。

【結果】Fig. 2、3 に、熱伝導率が 1.4 W/m·K お よび 16.5 W/m·K の場合の発電密度と Si-NW サ

イズの関係を示す。青い矢印で示すようにNW長 が長くなるほど最大発電量が得られる NW 幅が 増加していく。赤い点は探索した範囲における 最大発電密度が得られた点である。NW が短い場 合、熱伝導率の大きさに依らず、NW の厚さが薄 いほど発電密度が増している。これは、NWが厚 くなることで熱抵抗が減少し、高音部と低温部 の温度差が付きにくくなるためと説明できる。 一方 NW 長が 1000nm の場合に注目すると、熱伝 導率 1.4 W/m·K では、NW 部が厚くなるほど発電 密度が高くなり、16.5 W/m·K の場合では厚さ 140nm で発電密度が最大となった。このように Si-NW の熱伝導率によって最適寸法が大きく変 わることがシミュレーションで明らかとなっ た。Si-NW を用いた熱電デバイスを設計するに は、Si-NW 部の正確な熱伝導率を知ることが不 可欠である。なお、本研究は JST-CREST (JPLJCR19Q5)の助成を受けている。

[1] A. Boukai et al., Nature, 451.7175 (2008) 168., [2] H. Zhang, et al., IEEE TED 65 (2018) 2016., [3] M. Tomita, et al., VLSI Symp. Tech. Dig. (2018) 93., [4] K. Oda, et al., SSDM, C-1-02 (2019)., [5] Arden L. Moore, Sanjoy K. Saha, et al., Appl. Phys. Lett 93, 083112(2008)., [6] A.Hockbaum, et al., Nature 451, (2008) 163., [7] Y. Goi, et al., JSAP Spring, 9p-W371-13 (2019).

